

MPI TS50 | 50 mm マニュアル・プローバー DC/CV RF測定用マニュアル・プローバー

顕微鏡、顕微鏡オプション

- さまざまな顕微鏡より選定可能
- MPI ST45実体顕微鏡またはMPI SZ10単眼鏡筒 (最大10倍ズーム、95 mm作動距離)
- モニター直接接続型HDMIカメラ(パソコンいらず)

顕微鏡マウント、保持機構

- 剛性の高い顕微鏡ブリッジ(保持機構)
- 顕微鏡XY方向旋回機構
- フォーカス・ブロック付Z方向調整機構(50 mm)

調整可能プラテン

- マイクロメーターにて高精度微調整
- 25 mmの調整範囲

プローブ・プラテン

- 高剛性、安定設計
- DC/CV、RF測定用設計
- RF測定用角型調整器のご用意あり

小型な設計

- 実験台におけるベース・プレート(300 x 300 mm)
- 振動吸収アブソーバー・ベース
- 省スペース設計
- ロードブル測定に最適

オプション

- 防振台
- EMIシールド付暗箱
- 真空ポンプ / エア・コンプレッサ
- 作業台 (温度コントローラ用ラック、パソコン、キーボード・トレイ付)
※オプションにてデュアル・モニター・スタンド、計測器トレイが取付可能



RFキャリブレーション

- 校正基板用補助チャック
- 高精度校正のためのセラミック材質
- 平坦度1 μm(高コンタクト精度)

モジュール式チャック

- 常温チャック
- DC/CVおよびRF測定用

DCおよびRFポジション

- 最大RF 2ポートまたはDC 6ポートまで搭載可能
- さまざまなポジションより選定可能
- DC/CV用およびRF測定用プローブ・アーム

チャック XY/θステージ機構

- ステージ・トラベル(XY 100 x 75 mm)
- 5 mm×25 mm精度のX Y/θマイクロメータ機構
- ±5° θ微調整機構
- クイック・リリース機構
- 独立した素早いXYナビゲーション

真空制御を前面に設置

- 操作が容易に
- チャック用、補助チャック用を明記